

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 6 部門第 1 区分
 【発行日】平成31年2月7日 (2019.2.7)

【公表番号】特表2018-500575(P2018-500575A)
 【公表日】平成30年1月11日 (2018.1.11)
 【年通号数】公開・登録公報2018-001
 【出願番号】特願2017-535658(P2017-535658)
 【国際特許分類】

G 0 1 N 21/17 (2006.01)

【 F I 】

G 0 1 N 21/17 6 2 0

【手続補正書】

【提出日】平成30年12月19日 (2018.12.19)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

放射源を含む、

自由空間光コヒーレンス断層映像法システムであって、

前記放射源は、少なくとも 1 つのプロープビームと、1 つの基準ビームとを生成し、当該自由空間光コヒーレンス断層映像法システムの前記基準ビームは、空間的にフィルタリングされ、該空間的にフィルタリングされる基準ビームの部分が、前記空間的にフィルタリングされる基準ビームの前記部分に対応するプロープ放射の部分を備える、少なくとも 1 つの干渉信号を形成し、それにより、結果として得られる干渉信号を効果的に空間的にフィルタリングし、

前記基準ビームは、前記基準ビームをある表面に集束させることによって空間的にフィルタリングされ、前記表面は、前記表面の所定の領域で反射的であり、該所定の領域は、前記集束させられる基準ビームのウエストの寸法の 1 ～ 4 倍と略等しい範囲内にある直径を有する、

自由空間光コヒーレンス断層映像法システム。

【請求項 2】

前記表面の前記所定の領域は、部分的に反射的であり、前記表面の反射率は、80 ～ 95 パーセントの範囲内にある、請求項 1 に記載の自由空間光コヒーレンス断層映像法システム。

【請求項 3】

前記部分的に反射的な表面は、屈折率分布型レンズの表面である、請求項 2 に記載の自由空間光コヒーレンス断層映像法システム。

【請求項 4】

前記表面の所定の領域で反射的である前記表面は、基準ミラー表面である、請求項 1 に記載の自由空間光コヒーレンス断層映像法システム。

【請求項 5】

80 ～ 95 パーセントの範囲内の反射率の所定の領域を有する第 2 の表面を更に含み、前記領域は、前記集束させられる基準ビームのウエストの寸法の 1 ～ 4 倍と略等しい範囲内にある直径を有し、前記第 2 の表面は、前記基準ミラー表面からの反射を受けるように方向付けられる、請求項 4 に記載の自由空間光コヒーレンス断層映像法システム。

【請求項 6】

基準放射及びプローブ放射を生成する放射源と、検出器と、基準放射のための経路であって、80～95パーセントの範囲内で反射する部分ミラーを含む経路と、基準ミラーと、プローブ放射のための経路と、前記基準放射及び前記プローブ放射によって形成され且つ前記検出器で受信される干渉信号を捕捉し且つ処理する手段とを含み、

前記部分ミラーは、その反射表面に事前に選択される領域を有することで、前記部分ミラーの前記事前に選択される領域と前記基準ミラーとの間で反射させられる放射が選択され、実質的に全ての他の放射が基準信号から濾過される、

改良された自由空間光コヒーレンス断層映像法システム。

【請求項 7】

前記部分ミラーの前記事前に選択される領域は、集束させられる基準ビームのウエストの寸法の値の1～4倍と略等しい範囲内の直径を有する、請求項6に記載の自由空間光コヒーレンス断層映像法システム。

【請求項 8】

基準放射及びプローブ放射を生成する放射源と、検出器と、基準放射のための経路と、基準ミラーと、プローブ放射のための経路と、前記基準放射及び前記プローブ放射によって形成され且つ前記検出器で受信される干渉信号を捕捉し且つ処理する手段とを含み、

前記基準ミラーは、その反射表面に事前に選択される領域を有することで、前記事前に選択される領域から反射される放射が選択され、実質的に全ての他の放射が基準信号から濾過され、

前記基準ミラーの前記事前に選択される領域は、集束させられる基準ビームのウエストの寸法の値の1～4倍と略等しい範囲内の直径を有する、

改良された自由空間光コヒーレンス断層映像法システム。